

真空コントローラーつき溶媒回収型
ダイアフラム真空ポンプシステム
LABOPORT® SC 840 G



特長

- 4つの運転モード
- 溶媒の沸点を自動で正確に検知
溶媒ライブラリ不要・混合溶媒に最適
- 吸気側トラップと排気側のコンデンサにより溶媒をより効率よく回収
- 高湿ガスに有効なガスバラスト搭載
- 腐食性溶媒に最適
- リモートコントローラーによりドラフトチャンバー外から安全な操作可能
- タッチスクリーンディスプレイで簡単操作
- ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠
II 3/-G Ex h II B+H2 T3 Gc

推奨アプリケーション

- ・エバポレータ・デシケーター/乾燥・脱気/脱泡・ろ過

排気速度[m ³ /h] @大気圧時	2,04
排気速度[L/min] @大気圧時	34
到達真空度[mbar abs.]	6,0
加圧圧力[bar]	0,1
電圧[V]	100 – 240
周波数[Hz]	50/60
保護等級	IP30
消費電力[W]	60
消費電流[A]	0,6 (240 V AC) 1,0 (100 V AC)
サーマルスイッチ、ヒューズ内蔵	

ポンプヘッド	TFM™ PTFE
ダイアフラム	PTFE コーティング
バルブ	FFKM

重量 (kg)	15.75
ホースコネクタ	吸入口：内径8~9.5mmのホースに適合 排気口：内径10mmのホースに適合
寸法 (mm)	真空ポンプシステム : 366 x 416 x 274 コントローラー : 162 x 96 x 51 ドッキングステーション: 96 x 88 x 101
対応可能ガス・環境温度 (°C)	+5 ~ +40

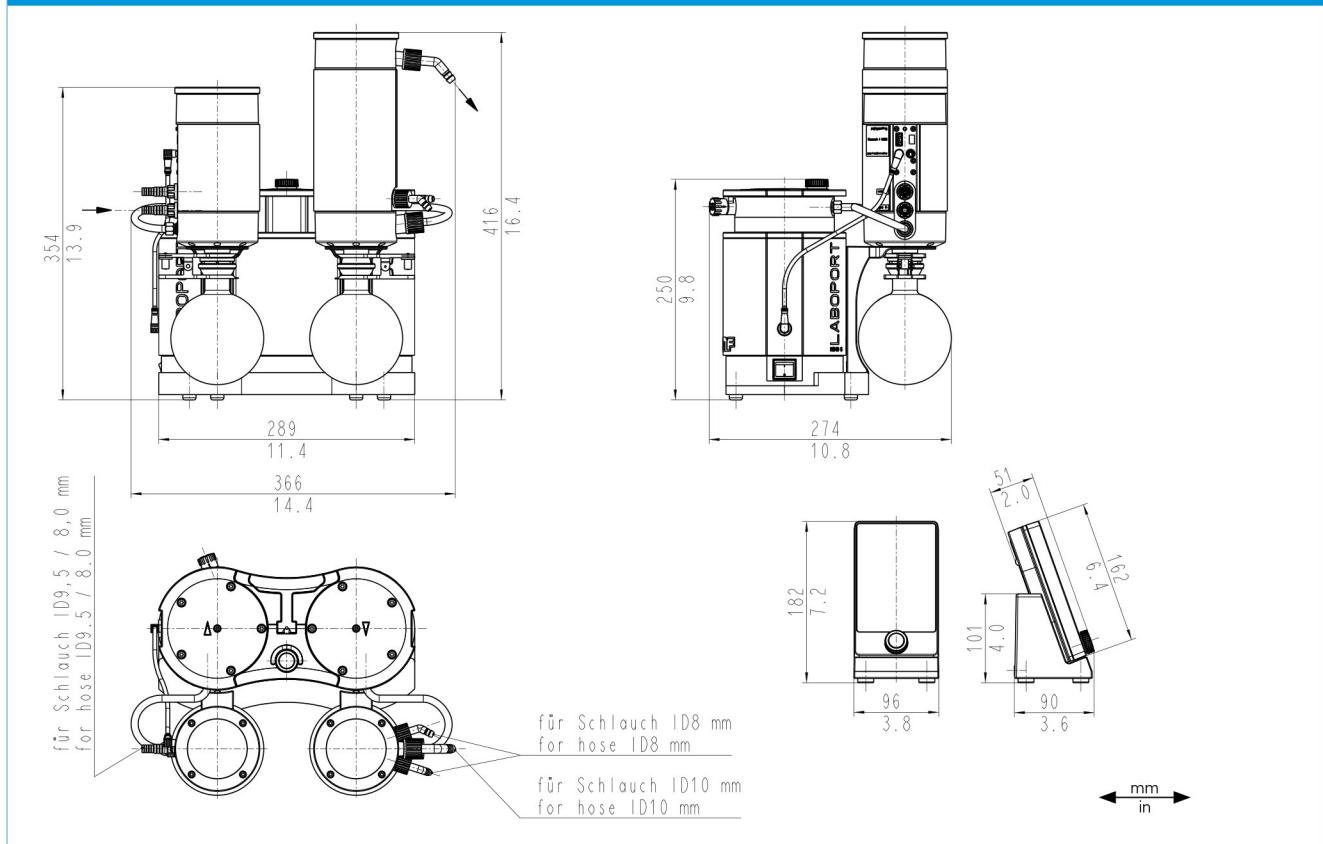
入力タイプ	USB-A (Bluetooth) USB-Mini/USB-C (ケーブル接続)
コントローラーの電源	内臓バッテリーまたは 付属のワイヤレス充電を 使用
バッテリー耐久時間	最大8時間
操作方法	タッチパネル ボタン操作
重量 (kg)	コントローラー : 0.69 ドッキングステーション: 0.26
バッテリー	ニッケルメタルハイブリッド (Ni/Mh)

	ID
N840G用スペアパーツキット	331052
システム用サービスキット*	338824

*331052のセット内容に加えてオリングが入ったシステム用のサービスキットです

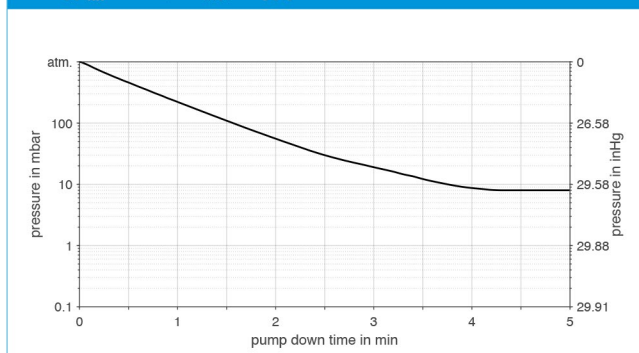
図面

SC 840 G

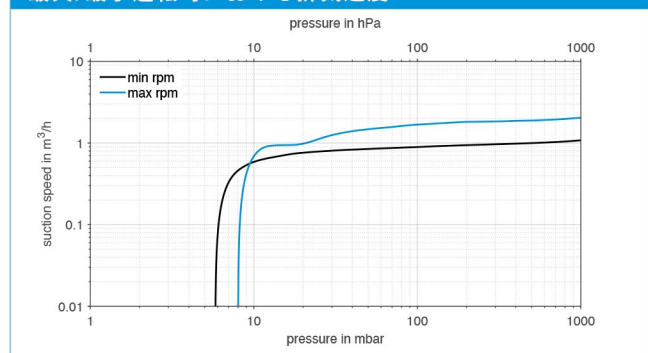


真空特性

20L容器における減圧時間



最大/最小運転時における排気速度



アクセサリ

アクセサリ	ID
セパレータフラスコ	047729
リークバルブ付き高性能コンデンサー	114855
ホースコネクタ+Oリング (FKM)	323609
ホースコネクタ PP (内径10mmのホースに適合)	026237
スクリーキャップ(赤) GL18 (ID: 026237のホースコネクタ用)	025980
ホースコネクタ PP (内径8mmのホースに適合)	025981

スクリーキャップ(赤) GL14 (ID: 025981のホースコネクタ用)	025982
ホースコネクタ用ジグ	316279
セパレータフラスコ用BGRホース (SC840 G用 x1)	329998
高性能コンデンサー用BGRホース (SC840G用 x1)	317157
ドッキングステーション	336784
コントローラ用バッテリー	339004